

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. február 18 – február 24.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8		Gubicza Jenő ezüst minta, hőkezelés előtt FIB felület megmunkálás EBSD vizsgálat VG, DZ	Technoorg, Bakai Zoltán, Lendvai Anna SEM_PREP Ar ágyú beállítás bemetszés próba, Si polikristály EBSD mérés VG, DZ, KSz	Radnóczy György TEM mintakészítés Si minta, 2db VG	Gubicza Jenő ezüst minta, hőkezelés után FIB felület megmunkálás EBSD vizsgálat VG, DZ		
9	Mikroszkóp sugármenetének beállítása VG						
10							
11	SEM-PREP 30 fokos bemetszés, felület finomítás, EBSD próbamérés VG, KSz						
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna